DERWENT-ACC-NO:

2001-020064

DERWENT-WEEK:

200103

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Exhaust gas dilution unit for exhaust

gas sampling

device, has controller which regulates

dilution air flow,

depending on the exhaust gas flow rate in

extraction tube

PATENT-ASSIGNEE: ONO SOKKI CO LTD(ONOSN)

PRIORITY-DATA: 1999JP-0096592 (April 2, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 2000292321 A October 20, 2000 N/A

800 G01N 001/22

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP2000292321A N/A

1999JP-0096592

April 2, 1999

INT-CL (IPC): G01N001/02, G01N001/22,

G01N001/36

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000292321A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Exhaust gas from the exhaust tube (1) is received in an extraction tube (3) and is supplied to a dilution tunnel (4). An air supply unit (5) supplies air for dilution, to the dilution tunnel. Flowmeter (11) detects the rate of exhaust gas flow in the tube (3). The controller (12) regulates dilution air flow, based on the detection output of flowmeter.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for exhaust gas sampling device.

USE - For exhaust gas sampling device.

ADVANTAGE - Exhaust gas flow rate is detected directly, thereby direct pressure control is enabled and hence raises sample collection accuracy.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows block diagram of sample dilution unit.



Exhaust tube 1

Extraction tube 3

Dilution tunnel 4

Air supply unit 5

Flowmeter 11

Controller 12

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/12

TITLE-TERMS: EXHAUST GAS DILUTE UNIT EXHAUST GAS SAMPLE DEVICE CONTROL REGULATE DILUTE AIR FLOW DEPEND EXHAUST GAS FLOW RATE EXTRACT TUBE

DERWENT-CLASS: S03

EPI-CODES: S03-E13; S03-E13C; S03-E13D;

SECONDARY-ACC-NO: Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-015334

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-292321 (P2000-292321A)

(43)公開日 平成12年10月20日(2000.10.20)

| (51) Int.Cl.7 | | 談別記号 | FΙ | | テーマコード(参考) |
|---------------|------|-------------|------|------|-------------------------|
| G01N | 1/22 | | G01N | 1/22 | M |
| | | | | | G |
| | 1/02 | | | 1/02 | D |
| | 1/36 | | | 1/28 | Z |

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

| (21)出顧番号 | 特額平11-96592 | (71)出版人 000145806 | 000145806 | | |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | 株式会社小野測器 | | | |
| (22)出顧日 | 平成11年4月2日(1999.4.2) | 神奈川県横浜市緑区白山一丁目16番1号 | 神奈川県横浜市緑区白山一丁目16番1号 | | |
| | | (72)発明者 関谷 光伸 | | | |
| | | 神奈川県横浜市緑区白山1-16-1 杉 | 朱式 | | |
| | | 会社小野測器内 | | | |
| | | (74)代理人 100092576 | | | |
| | | 金田子 総田 久男 | | | |

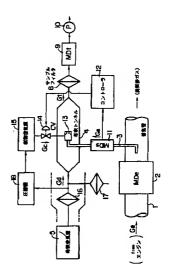
(54) 【発明の名称】 抽出希釈装置及びサンブル採取装置

(57)【要約】

(19)日本国特許庁(JP)

【課題】 マイクロ希釈トンネル内の圧力を一定に保 ち、PM測定精度を悪化させることなく、部分希釈全量 サンプル採取方式を実現する.

【解決手段】 排ガスの一部を抽出する抽出管3と、希 釈用空気を発生する希釈空気源5と、抽出管3で抽出し た抽出ガスを、希釈用空気によって希釈する希釈トンネ ル4と、制御用空気を発生する制御空気源15と、抽出 管3の抽出流の流量を検出する流量計11と、流量計1 1の検出結果に基づいて、制御用空気によって抽出流の 流量を制御するコントローラ12,制御弁14、コント ロールノズル13等を含み、希釈トンネル4で希釈した 希釈排ガスの全量を、サンプルフィルタ8で採取する。



09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000

【特許請求の範囲】

1 【請求項1】 希釈対象流体の一部を抽出する抽出手段

希釈用流体を発生又は流入する希釈流体源と、

前記抽出手段で抽出した希釈対象流体を、前記希釈用流 体によって希釈する希釈手段と、

制御用流体を発生又は流入する制御流体源と、

前記抽出手段の抽出流の流量を検出する抽出流量検出手 段と、

用流体の流量又は圧力を制御する抽出流制御手段と、を 備えた抽出希釈装置。

【請求項2】 請求項1に記載の抽出希釈装置におい て、

前記希釈流体源は、一定圧の状態に維持することを特徴 とする抽出希釈装置。

【請求項3】 請求項1に記載の抽出希釈装置におい て、

前記希釈流体源は、大気に解放されていることを特徴と する抽出希釈装置。

【請求項4】 請求項1に記載の抽出希釈装置におい

前記制御流体源は、前記希釈用流体の圧力を調整して用 いることを特徴とする抽出希釈装置。

【請求項5】 請求項1から請求項4までのいずれか1 項に記載の抽出希釈装置において、

前記抽出流制御手段は、

前記抽出手段の抽出流放出部又は流路に設けられ、前記 制御用流体を流入する流入部と、

体の流量を制御する流量制御部と、

を備えることを特徴とする抽出希釈装置。

【請求項6】 請求項1から請求項4までのいずれか1 項に記載の抽出希釈装置において、

前記抽出流制御手段は、

前記抽出手段の抽出流放出部に対向して配置され、前記 制御用流体を対向流として放出する対向流放出部と、 前記対向流放出部を前記抽出流放出部に対して、抽出流 軸方向の略垂直方向及び/又は略平行方向に移動させ、 或いは、抽出流軸方向の相対角を変化させる駆動部と、 を備えることを特徴とする抽出希釈装置。

【請求項7】 請求項1から請求項4までのいずれか1 項に記載の抽出希釈装置において、

前記抽出流制御手段は、

前記抽出手段の抽出流放出部に対向して配置され、前記 制御用流体を対向流として放出する対向流放出部と、 前記対向流放出部と前記抽出流放出部との間に設けら れ、前記制御用流体の一部を遮蔽する遮蔽部と、を備え ることを特徴とする抽出希釈装置。

【請求項8】 請求項1から請求項7までのいずれか1 50 御弁(CV)6,流量計(MDd)7が設けられてい

項に記載の抽出希釈装置と、

前記抽出希釈装置で希釈された流体の全量に含まれる政 量物質をサンプルとして採取するサンプル採取手段と、 を備えたサンプル採取装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車の排出ガス 等の希釈対象流体をサンプリング (抽出) して希釈する 抽出希釈装置、及び、その希釈された流体に含くまれて 前記抽出流量検出手段の検出結果に基づいて、前記制御 10 いる微量物質 (パーティキュレートマター;以下、PM という)をサンプル(標本)として採取するサンプル採 取装置に関するものである。

【0002】図10は、サンプル採取装置の分類を示し た図である。この種のサンプル採取装置は、図10 (A) に示すように、エンジンEの排気管Exからの排 ガスの全量(1/1)をとって、全量希釈トンネルFD T内の一部量 (例えば、1/1000~1/4000) をサンプルフィルタSFで採取する全量希釈部分サンプ ル採取方式 (フルダイリューショントンネル方式)と、 図10(B)に示すように、エンジンEの排気管Exか らの排ガスを分流器Dvで一部量分流し(例えば、1/

TUU)、ミニ希釈トンネルmDT内の一部量(例え ば、 $1/10\sim1/40$)をサンプルフィルタSFで採 取する部分希釈部分サンプル採取方式(ミニダイリュー ショントンネル方式)と、図10(C)に示すように、 エンジンEの排気管Exからの排ガスを分流器Dvで一 部量分流し(例えば、1/1000~1/4000)、 マイクロ希釈トンネルμDT内の全量(1/1)をサン プルフィルタSFで採取する部分希釈全量サンプル採取 前記流入部の上流側に設けられ、流入する前記制御用流 30 方式(マイクロダイリューショントンネル方式)とに分 類される。

> 【0003】図10の(A)(B)(C)方式の順に、 測定精度が悪くなるが、装置が小形化し、コストダウン が図れるという利点がある。

【0004】図11は、従来のサンプル採取装置(部分 希釈全量サンプル採取方式) の一例を示す模式図であ る。この抽出希釈装置は、エンジンからの排ガスが排気 される排気管1の途中に流量計(MDe)2が設けられ ている。この流量計 (MDe) 2は、排気管 1内を流れ 40 る排ガスのエンジン総排出流量(Ge)を測定する。抽 出(サンプリング)管3は、排気管1から予め設定され た分流比(SR:通常1000~4000)に従ったサ ンプリング流量(Gs)を抽出して、希釈トンネル4に 導入する。このとき、次式の関係がある。

【0005】Gs=Ge/SR ···(式1) ただし、SR:分流比

【0006】希釈トンネル4は、希釈空気源5からの希 釈空気によって、導入された排ガスを希釈するものであ る。希釈空気源5から希釈トンネル4への管路には、制

る。希釈トンネル4に導入された一部量の排ガスは、希 釈空気源5からの希釈空気により希釈され、希釈排ガス となる。このときのサンプリング流量Gsは、希釈空気 流量Gdと希釈排ガス流量Gtの関数となる。すなわ ち、次式の関係がある。

[0007]

Gs = f(Gt, Gd)・・・(式2)

【0008】希釈排ガスは、サンプルフィルタ8を通し て、予め設定された一定量でポンプ10によって吸引さ れる。このときの流量は、流量計(MDt) 9により計 10 (1)(式2)に関して、GsとGt,Gdの量的関係 測され、測定値 (Gt) が得られる。サンプルフィルタ 8は、希釈排ガス中のPMを採取し、別途後処理した後*

Gs:Gd:Gt=1:9:10~1:39:40 ···(式3)

程度であり、Gsの算出は、10~40倍の広い測定レ ンジである流量計 (MDd, MDt) から求めることと なり、Gsの値の精度確保が困難であり、PMの測定精 度を悪化させる主要因となっている。

の関係は、

 $Gs:Gd:Gt=1:9:10\sim1:59:60$

· · · (式4) $=1:39:40\sim1:159:160$

となり、さらに困難な問題となっている。

【0012】(3) 希釈トンネル内の圧力に関し、流 量は、(式1), (式2)の関係を常に成立させるため に、希釈トンネル内圧は、排気管内のサンプリングポイ ントSP(図11参照)の圧力状態に影響され、一定値 とはならない。このことは、希釈トンネル内での未だ十 分には解明されていないPMの生成又は生長過程の問題 に影響を及ばす可能性があり、望ましいものではない。 現在、PM測定装置は、全量希釈部分サンプル採取方式 (フルダイリューショントンネル方式) が基準器である が、この場合に、希釈トンネル内圧は、常時、ほぼ大気 30 希釈装置である。

【0013】(4) 希釈トンネル内の圧力が常時変動 する状況下であっても、希釈排ガスの流量を、常時一定 流量に保つ必要があるが、実状としては困難であり、P M測定精度の悪化の原因となっている。

【0014】本発明の目的は、希釈トンネル内の圧力を 一定に保ち、PM測定精度を悪化させることなく、部分 希釈全量サンプル採取方式を実現できる抽出希釈装置及 びサンプル採取装置を提供することである。

[0015]

圧となっている。

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に、請求項1の発明は、希釈対象流体の一部を抽出する 抽出手段(3)と、希釈用流体を発生又は流入する希釈 流体源(5)と、前記抽出手段で抽出した希釈対象流体 を、前記希釈用流体によって希釈する希釈手段(4) と、制御用流体を発生又は流入する制御流体源(15) と、前記抽出手段の抽出流の流量を検出する抽出流量検 出手段(11)と、前記抽出流量検出手段の検出結果に 基づいて、前記制御用流体の流量又は圧力を制御する抽 *に、その採取が重量測定される。

【0009】このサンプル採取装置では、サンプリンク 流量(Gs)が、時々刻々変化するエンジン総排出流量 (Ge)に従って、(式1)が成立するようにする必要 があるので、制御弁(CV)6は、(式2)の関係に従 って、希釈空気流量(Gd)の値を制御する。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前述した従来 の方式は、以下のような問題点があった。

は、代表的な例では、

※【0011】(2) Geのダイナミックレンジは、対 象エンジンにより、約4~6倍程度あり、前記(式3)

20★釈装置である。 【0016】請求項2の発明は、請求項1に記載の抽出 希釈装置において、前記希釈流体源は、一定圧の状態に

維持することを特徴とする抽出希釈装置である。 【0017】請求項3の発明は、請求項1に記載の抽出 希釈装置において、前記希釈流体源は、大気に解放され ていることを特徴とする抽出希釈装置である。

【0018】請求項4の発明は、請求項1に記載の抽出 希釈装置において、前記制御流体源は、前記希釈用流体 の圧力を調整して用いること(18)を特徴とする抽出

【0019】請求項5の発明は、請求項1から請求項4 までのいずれか1項に記載の抽出希釈装置において、前 記抽出流制御手段は、前記抽出手段の抽出流放出部又は 流路に設けられ、前記制御用流体を流入する流入部(1 3)と、前記流入部の上流側に設けられ、流入する前記 制御用流体の流量を制御する流量制御部(14)と、を 備えることを特徴とする抽出希釈装置である。

【0020】請求項6の発明は、請求項1から請求項4 までのいずれか1項に記載の抽出希釈装置において、前 40 記抽出流制御手段は、前記抽出手段の抽出流放出部に対 向して配置され、前記制御用流体を対向流として放出す る対向流放出部(21)と、前記対向流放出部を前記抽 出流放出部に対して、抽出流軸方向の略垂直方向及び/ 又は略平行方向に移動させ、或いは、抽出流軸方向の相 対角を変化させる駆動部(22)と、を備えることを特

徴とする抽出希釈装置である. 【0021】請求項7の発明は、請求項1から請求項4 までのいずれか1項に記載の抽出希釈装置において、前 記抽出流制御手段は、前記抽出手段の抽出流放出部に対 出流制御手段(12,13,14)と、を備えた抽出希★50 向して配置され、前記制御用流体を対向流として放出す

る対向流放出部(21)と、前記対向流放出部と前記抽 出流放出部との間に設けられ、前記制御用流体の一部を 遮蔽する遮蔽部 (23)と、を備えることを特徴とする 抽出希釈装置である。

【0022】請求項8の発明は、請求項1から請求項7 までのいずれか1項に記載の抽出希釈装置と、前記抽出 希釈装置で希釈された流体の全量に含まれる微量物質を サンプルとして採取するサンプル採取手段(8)と、を 備えたサンプル採取装置である。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、図面などを参照しながら、 本発明の実施の形態をあげて、さらに詳細に説明する。 (第1実施形態)図1は、本発明によるサンプル採取装 置の第1実施形態を示す図である。なお、以下に説明す る各実施形態では、前述した従来例と同様な機能を果た す部分には、同一の符号を付して重複する説明を適宜省 略する。

【0024】流量計 (MDs) 11は、抽出管3に設け られ、排気管1から希釈トンネル4に導入される排ガス の一部の流量を直接測定するためのものであり、例え ば、超音波流量計などが用いることができる。この流量 計(MDs)11の測定結果は、コントローラ12に出 力される。流量計 (MDs) 11は、排ガスの一部(抽 出流)の流量を直接測定するので、Gsの測定精度の問

【0025】コントロールノズル13は、抽出管3の出 口に設けられ、希釈トンネル4に導入する排ガスの流量 を制御するノズルである。このコントロールノズル13 には、制御空気源15からの制御用空気が制御弁(C V) 14を介して、接続されている。制御弁(CV)1 30 御することが可能となる。 4は、コントローラ12からの制御信号により流量が調 整される。

題点(1)、(2)が解決される。

【0026】制御空気源15は、希釈空気源5からの希 釈用空気を、清浄にするためのフィルタ16を通して、 圧縮機18で圧縮した空気が供給される。また、フィル タ16を通した空気は、空気中に含まれるPMをサンプ リングするバックグラウンドサンプリングフィルタ17 にも供給される。

【0027】本実施形態では、一部の排ガスは、希釈ト ル13を経て、希釈トンネル4内に導入される。希釈ト ンネル4内に導入された一部量(Gs)の排ガスと、制 御用空気量(Gc)とは、常時、ほぼ大気圧の希釈空気 により希釈され、希釈排ガスとなる。このときの関係式 は、(式5)となる。

[0028]

・・・(式5) Gt = f(Gs, Gc) + Gd【0029】但し、流量計(MDs)11によって、G sを直接測定しているので、Gtを流量計(Mdt)9 で測定する以外は、Gc、Gdの値を知る必要はない。

なお、前述した(式1)を満たす必要があることは従来 と同様である。従って、希釈トンネル4の内圧は、常時 ほぼ大気圧状態となり、従来方式の問題点(3)が解決 される。同様に、問題点(4)が解決される。

【0030】(第2実施形態)図2は、本発明によるサ ンプル採取装置の第2実施形態を示す図である。第2実 施形態は、抽出管3の出口(抽出流放出部) 3 a に対向 して配置され、制御空気源15の制御用空気を対向流と して放出する対向流管21と、対向流放出管21を、抽 10 出管3の出口3aに対して、抽出流軸方向の略垂直方向 及び/又は略平行方向に移動させ、或いは、抽出流軸方 向の相対角を変化させる駆動部22が設けられている。 また、希釈トンネル4は、希釈用フィルタ16を介し

【0031】図3~図7は、第2実施形態によるサンプ ル採取装置の対向流による抽出流制御機構を示す図であ る。図3は、対向流管21を抽出管3に対して、抽出流 方向(矢印S)と略垂直方向に、wa(=0), wb, wcだけ移動した場合を示している。図3(a),

(b), (c)の各状態における抽出管3の出口3a近 20 傍の圧力を、それぞれpa, pb, pcとすると、Vc

が一定の条件下では、次の関係が成立する。

て、大気に連通している大気開放型である.

. . . (6) [0032]Pa>Pb>Pc

【0033】また、抽出管3内の流量を、それぞれGs a, Gsb, Gscとすると、抽出管3の入口の圧力P eが一定の条件下では、次式の関係が成立する。

[0034]Gsa<Gsb<Gsc 【0035】従って、抽出管3と対向流管21の相対位 置を適切に調整することにより、抽出流の流量Gsを制

【0036】図4は、対向流管21を抽出管3に対し て、抽出流軸方向(矢印S)と平行方向に、La(=基 準備)、Lb、Lcだけ移動した場合を示している。図 5は、対向流管21を抽出管3に対して、抽出流軸方向 (矢印S) と相対角を、 θ a(=0), θ b, θ cだけ 変化させた場合を示している。これらの場合も、対向流 管21を抽出管3に対して、適切に調整することによ り、抽出流の流量Gsを制御することが可能となる。

【0037】図6は、対向流管21と抽出管3との間に ンネル4への流入量を制御するためのコントロールノズ 40 挿入され、対向流の一部を遮蔽する遮蔽物23が設けら れており、この遮蔽物23の位置を、抽出流方向(矢印 S)と略垂直方向に、ta(=0), tb, tcだけ移 動したものである。この場合は、遮蔽物23の位置を適 切に調整することにより、抽出流の流量Gsを制御する ことが可能となる。

> 【0038】図7は、対向流管21及び抽出管3の出口 付近の断面形状を目的に合わせて変更したものである。 この場合は、それぞれの出口付近の断面形状を、適切に 設計することにより、抽出流の流量Gsの制御特性を選 50 定することが可能となる。

【0039】図8は、第2実施形態によるサンプル採取

装置の対向流による抽出流制御機構の変形例を示す図で ある。図8の例では、抽出管3の先端に第1実施形態と 同様なコントロールノズル13を設け、そのコントロー ルノズル13への導入管24に、対向流管22を配置し たものである。対向流管22の調整は、図3~図7まで の方法を同様に適用することができる。

【0040】図12は、第2実施形態によるサンプル採 取装置の対向流による抽出流制御機構の他の変形例を示 す図である。図2では、抽出管3の出口3aと対向流管 10 示す図である。 21の流路の方向が、希釈トンネル4内の流れの方向と 略直交する方向に配置されている例で示したが、図12 (A) に示すように、抽出管3の出口3a付近に枝管を 設けて排出口としたり、図12(B)に示すように、抽 出管3と対向流管21の出口付近を曲げて、抽出ガスの 排出方向を、希釈トンネル4内の流れの方向に合わせる ことが望ましい。

【0041】(第3実施形態)図9は、本発明によるサ ンプル採取装置の第3実施形態を示す図である。第3実 1によって、排気管1から希釈トンネル4に導入される

排ガスの一部の流量を直接測定するのは第1実施形態と 同じであるが、コントローラ12によって、抽出管3の 途中に設けられた流量調整弁19を制御するようにした ものである。ここでは、制御空気源15は、希釈空気源 5とは別の清浄な高圧空気源を用いている。

【0042】(変形形態)以上説明した実施形態に限定 されることなく、種々の変形や変更が可能であって、そ れらも本発明の均等の範囲内である.

(1) 希釈用流体は、空気の例で説明したが、希釈対象 30 6 制御弁(CV) 流体の種類によっては、不活性ガスなどを用いてもよ 11.

[0043]

【発明の効果】以上詳しく説明したように、本発明によ れば、測定対象流体の一部を抽出した抽出流の流量を直 接検出して、その抽出流の流量又は圧力を、制御用流体 を用いて制御するので、希釈手段内の圧力を一定に保つ ことが可能となり、サンプル採取の精度を向上させるこ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるサンプル採取装置の第1実施形態 を示す図である.

【図2】本発明によるサンプル採取装置の第2実施形態 を示す図である.

【図3】第2実施形態に係る対向流による抽出流制卸機 構の対向流管を抽出管に対して、抽出流方向と略垂直方

向に移動させた場合を示す図である。

【図4】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機 構の対向流管を抽出管に対して、抽出流方向と略垂直方 向に平行させた場合を示す図である。

8

【図5】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機 構の対向流管を抽出管に対して、抽出流方向と相対角を 変化させた場合を示す図である。

【図6】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機 構の対向流管と抽出管との間に遮蔽物を挿入する場合を

【図7】第2実施形態に係る対向流による抽出流制御機 構の対向流管及び抽出管の出口付近の断面形状を示した 図である.

【図8】第2実施形態によるサンプル採取装置の対向流 による抽出流制御機構の変形例を示す図である。

【図9】本発明によるサンプル採取装置の第3実施形態 を示す図である.

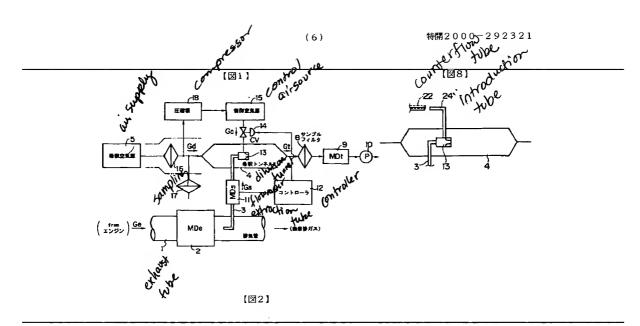
【図10】一般的なサンプル採取装置の分類を示した図 である。

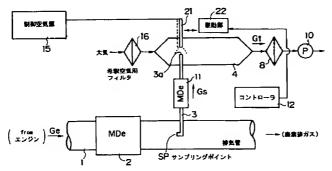
施形態では、抽出管3に設けられた流量計 (MDs)1 20 【図11】従来のサンプル採取装置(部分希釈全量サン プリング方式)の一例を示す図である。

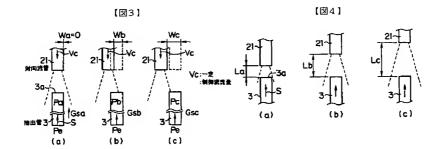
> 【図12】第2実施形態によるサンプル採取装置の対向 流による抽出流制御機構の他の変形例を示す図である。 【符号の説明】

- 1 排気管
- 2 流量計 (MDe)
- 3 抽出管
- 4 希釈トンネル
- 5 希釈空気源
- 7 流量計 (MDd)
- 8 サンプルフィルタ
- 9 流量計(MDt)
- 10 ポンプ
- 11 流量計 (MDs)
- 12 コントローラ
- 13 コントロールノズル
- 15 制御空気源
- 14 制御弁(CV) 40 16 希釈用フィルタ
 - 17 バックグラウントサンプリングフィルタ
 - 18 圧縮機
 - 21 対向流管
 - 22 駆動部
 - 23 遮蔽物

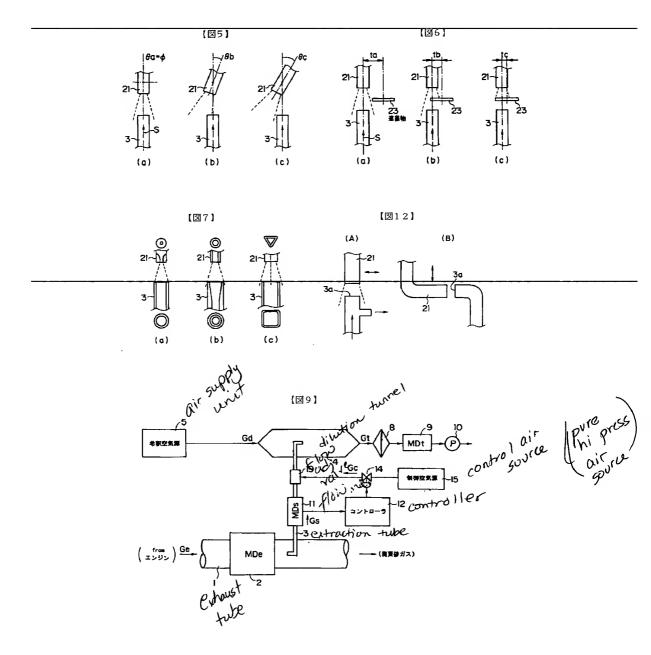
09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000





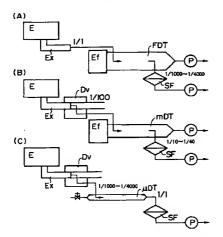


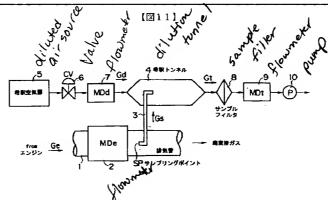
09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000



09/15/2003, EAST Version: 1.04.0000

(210)





PAT-NO:

JP02000292321A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000292321 A

TITLE:

EXTRACTING AND DILUTING DEVICE

AND SAMPLE COLLECTING DEVICE

PUBN-DATE:

October 20, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEKIYA, MITSUNOBU

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ONO SOKKI CO LTD

N/A

APPL-NO: JP11096592

APPL-DATE: April 2, 1999

INT-CL (IPC): G01N001/22, G01N001/02,

G01N001/36

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a partial dilution/entire amount collection method while maintaining a pressure inside a micro dilution tunnel without deteriorating PM(particulate matter) measuring precision.

SOLUTION: This collecting device contains an extracting pipe 3 extracting a part of exhaust gas, a diluting air source 5 generating air for dilution, a dilution tunnel 4 using the diluting air to dilute gas extracted at the extracting pipe 3, a control air source 15 generating air for control, a flow meter 11 detecting flow rate of extracted flow at the extracting pipe 3, and a controller 12, a control valve 14 and control nozzle 13 using the control air to control the flow rate of the extracted flow based on a detection result from the flow meter 11. Entire amount of diluted exhaust gas diluted at the dilution tunnel 4 is collected at a sample filter 8.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO